## ® 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### ② 公 開 特 許 公 報(A) 平3-188372

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)8月16日

G 01 N 27/447

7235-2G G 01 N 27/26

335 E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

会発明の名称

電気泳動分析装置

②特 願 平1-329161

願 平1(1989)12月19日 22出

俵 木 個発 明 者

紀明 --- **A**B 東京都武蔵野市中町2丁目9番32号 横河電機株式会社内 東京都武蔵野市中町2丁目9番32号

横河電機株式会社内

@発 明 者 坪 Œ @発 明 者 闡

宗 樹 東京都武蔵野市中町2丁目9番32号

横河電機株式会社内

横河電機株式会社 ⑪出 願 人

東京都武蔵野市中町2丁目9番32号

個代 理 人 弁理士 小沢 信助

DE AN

1. 発明の名称

電気泳動分析装置

2. 特許請求の範囲

ターミナル電解液槽およびリーディング電解液 措備から泳動細管にターミナル電解液およびリー ディング電解液をそれぞれ導入し、これら電解液 の境界に試料溶液を注入し、試料液中のイオンを 電気泳動選度の違いによって泳動分離させ、その イオンの電気伝導度や電位勾配を検出電極により 検出して前記試料液の成分を分析する電気泳動分 析装置において、前記泳動網管を2枚の基板を張 りあわせて形成するとともに、前記検出電極を前 記細管の途中に薄膜により形成し、前記差板の一 方に形成した貫通孔を介して前記電極からの信号 を取出すようにしたことを特徴とする電気泳動分 析装置.

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、組管式等速電気泳動分析装置に関し、

さらに詳しくは電極形成時の生産性の向上をはか った電気泳動分析装置に関する。

く従来の技術>

等速電気泳動分析は、分離分析の一種でリーデ ィング液となる分析対象イオンよりも高移動度の 同符号イオンを含む電解液と、ターミナル液とな る分析対象イオンよりも低移動度の同符号イオン を含む電解液を泳動器管内で界面で接触させ、そ の界面に試料溶液(以下、単に試料という)を注 入して経管の函端に定撃圧を印加することにより 分析対象イオンをその移動度の順に分離させ、分 **健したイオンの導電度や電位勾配を測定する事に** より定性や定量を行う分析法である。

第6図はこの様な装置の従来例を示すもので、 1はターミナル監解液積、2はリーディング電解 液槽であり、これら電解液層中には高電圧電波3 に接続された電桶4、5が浸漬されている、6は 泳動船管で、その関端は電解液層1、2に換続さ れている。7は泳動棚管の途中に設けられた検出 器、8、9は電解液構への液量の制御を行うスト

ップパルブである。10は試料注入バルブでこの パルブを開閉してマイクロシリンジ12により試 料が注入される。なお、泳動細管および検出器は 恒温権11内に配置されている。

### <発明が解決しようとする課題>

上記従来例において、検出器7は第7図(a) に新面図で示す様に構成されている。第7図(c) は電極部の拡大図で(b) は電極と対向 する電極したが電視で用、(c)図はは対向 する電視である。これの図において20はは外径 6 mm程度のパイレックスがラスを10mm程度のパイレックスがきないがインカーのでははなかの 度のデオーなどである。において20はは不の 変のテフロンキャップである。パイレックスがされた外径10mm 度のデオールである。これが単位の記を20mm を変したが明報である。これが単位の記を20mm を変したが明報である。21位の がラスの中には試料の遊電度や対向してエボラースである。23 が埋め込まれている。25 により 対路ではより対止されている。25 により がは自金電極の一端に接続された引出し終。27 は泳動網管を保護するデフロンチューブである。

リーディング電解液をそれぞれ導入し、これら電 解液の境界に試料液液を注入し、試料液中のイオ ンを電気泳動速度の違いによって泳動分離させ、 そのイオンの電気伝導度や電位勾配を検出電電気 が放出して前記試料液の成分を砂 動分析装置において、前記泳動網管を2枚の電気 を削りあわせて形成するとともに、前記を検 を前記網管の途中に薄膜により形成し、前記基板 の一方に形成した貫通孔を介して前記を板 の一方に形成した貫通孔を介して前記を板 ので ある。

## <作用>

薄膜技術を用いて検出電極を対向して形成し、 その対向する電極の中心を通るように溝をエッチ ングで形成するので半導体プロセスを用いて安値 に大量に生産が可能となる。

## く実施例>

以下、図面に従い本発明を説明する。第1図は 本発明の一実施例を示す全体構成図である。第1 図において10は表面に渦巻き状の消(泳動組管) ところで、上記検出器の構成においては泳動船管の外径が320μm程度、内径が50μm程度であり、この様な網管の中に白金電板を埋め込む際は網管に対向する貫通孔や、一定のずれをもたせて貫通孔を開ける訳であるが、先に述べた様にこの孔は非常に小さく、また、ガラス管が硬いことから従来はガスレーザを用いて形成している。

しかしながら、ガスレーザで孔を開ける場合は 位置合せやレーザ光の強さを精密に制御すること が非常に難し生産面、コスト面で問題があった。

本発明は上記従来技術の問題を解決するためになされたもので、シリコン基板上に薄膜技術を用いて対向して検出電極を形成し、その対向する電極の中心を通るようにエッチングで溝を形成することにより、製作の容易な低コストの電気泳動装置を実現することを目的とする。

#### く課題を解決するための手段>

上記従来技術の課題を解決する為の本発明の構成は、ターミナル電解液構およびリーディング電解液槽側から泳動組管にターミナル電解液および

12が形成された第1のシリコン基板である。13は黄通孔15a~d(一部を断断で示している為15b、15cは省略している)が形成された第2のシリコン基板である。なお、上記第1、第2のシリコン基板の大きさは厚さり、5mm、簡100mm²程度である。18a、18bはパイプで吸入側のパイプ18aの一端はターミナル電解液槽1に挿入され他端は貫通孔(15cで示す位置)を介して溝12の一端に連通している。

排出個のパイプ18bの一端はリーディング電解液槽2に挿入され他端は貫通孔15dを介して消12の他端に連通している。21は高圧電源で負の電板4がターミナル電解液槽1に正の電極5がリーディング電解液槽2に挿入されている。22は溝の途中の両側に形成された検出電板、23は試料を注入するインジェクタである。

上記構成において高圧電源21から電圧を印加 するとインジェクタ23から電解液の界面に注中 された試料中のイオンはその移動度の順に分離し ながら相管12中をターミナル液構1側からリー

# 特開平3-188372(3)

ディング液桶 2 側へ流れ、検出電板 2 2 およびこれに接続された図示しない公知の信号検出回路により試料の成分に応じた導電度や電位勾配を測定することができる。

第2図は海(相信)と電極および貫通孔(電極 取出し孔)15a、15bの位置関係を示すもの で、海電度を測定する場合の拡大斜視図である。 図において符号は第1図と同様であり、検出を の一端(A)部の優もは例えば20μm程度とさ れ、海12を介して対向して配置されている( 促送を測定する場合は対向する電極を50μm程 度ずらす)。B部は接続端子となるもので第2の 基板13に形成された貫通孔15aおよび15b に露出する位置に形成される。

第3図(a)~(d)はシリコン基数に第2図に示す電極および溝を形成する瞬略工程を示すものである。工程に従って説明する。

### 工程(a)

第1のシリコン基板10に酸化膜30, 壁化膜31, リフトオフ層32およびレジスト層33を

# 工程(b)

残った酸化膜をマスクとしてヒドラジン液を用いて異方性エッチングを行い貫通孔15を形成する。 (b) 図参照)

第5図は第3図、第4図により作製した第1、 第2のシリコン基板を張りあわせて泳動網管を形成した状態を示している。2枚の基板は充分に熱 酸化限を形成後表面にポリイミド樹脂を塗布し加 然して固着する。

なお、本実施例においては基板をシリコンとして説明したが、シリコンに優らず例えばガラスであっても良く、その組み合わせであってもよい、 また、基板どうしの園肴はポリイミド樹脂に限定するものではない。

### <発明の効果>

以上実施例とともに具体的に説明した様に本発明によれば、泳動細管および検出電極を基板上に形成する様にしたので、細管はフォトリソグラフィの技術を用い、電極はスパッタリングや蒸着の技術を用いることにより生産性を飛躍的に向上さ

順次積層し、そのレジスト層を検出電極の形状に パターニングしてリフトオフ層 3 2 を露出させる。 (図 a 教照)

#### 工程(も)

パターニングで露出した部分のリフトオフ層3 2を除去し、露出した窒化膜31の上に検出電極となるCrおよびPtの薄膜35をスパッタや蒸 着などにより形成する。 (図b参照)

### 工程(c)

リフトオフを行って窒化膜31および検出電極35を残して他の層を除去する。 (図c参照)T程(d)

窒化膜31を溝の形状にパターニングし、硝剤 酸液を用いて等方性エッチングを行う、

第4図(a)、(b)は第2のシリコン高板に 貫通孔を形成する概略工程を示すものである。

## 工程(a)

シリコン基板13に酸化膜を形成後レジスト膜を形成し、量通孔を形成すべき箇所をパターニングし、賃出させた酸化膜を除去する。(図a参照)

せることができる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の電気泳動分析装置の一実施例を示す構成説明図、第2図は電極部分を拡大して示す斜視図、第3図~第5図は検出電極と泳動細管の製作工程の類略を示す図、第6図は従来装置の全体構成図、第7図は従来装置の検出器の拡大図である。

1 … ターミナル電解液槽、2 … リーディング電解液槽、3 …高電圧電源、10、13 … シリコン基板、12 … 溝(泳動網管)、15 … 貫通孔、22 a、22 b … 検出電極、23 … インジェクタ、

代理人 弁理士 小 沢 信



## 特開平3-188372(4)



